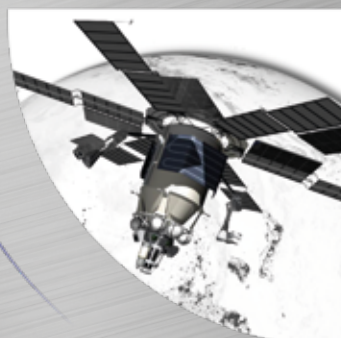
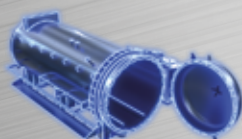
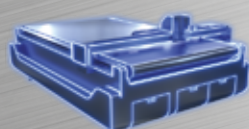
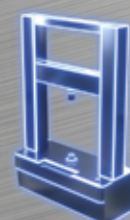
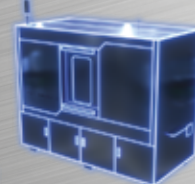




КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С 1997 г.



Измерительные системы «рука»  
с лазерными сканерами



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Диапазон измерений | до 5 м      |
| Погрешность        | от ± 20 мкм |

Портативные (ручные)  
лазерные сканеры

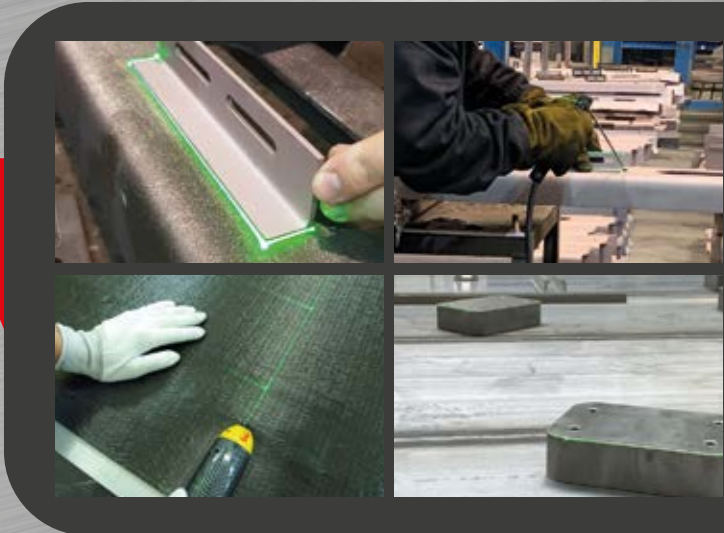


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Диапазон измерений | до 12 м     |
| Погрешность        | от ± 20 мкм |

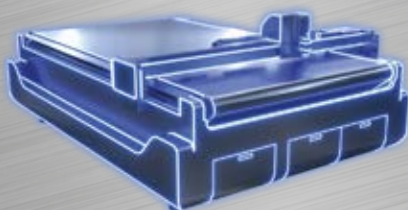
Системы лазерного  
проецирования



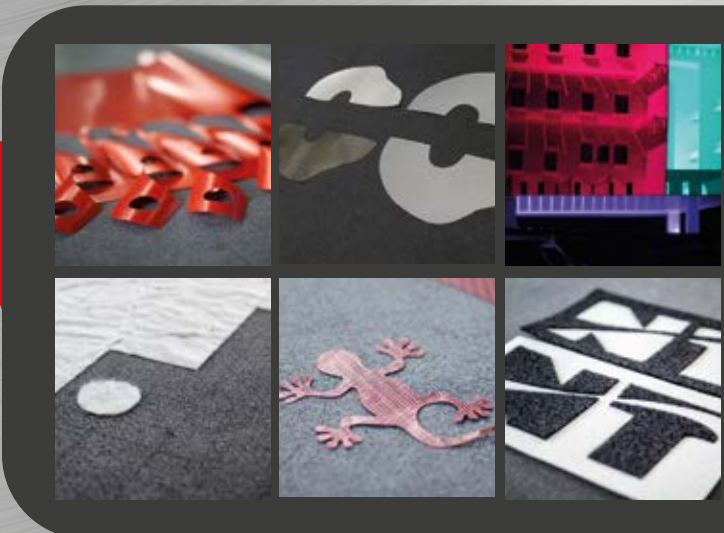
Универсальные лазерные шаблоны  
Построение технологического  
процесса



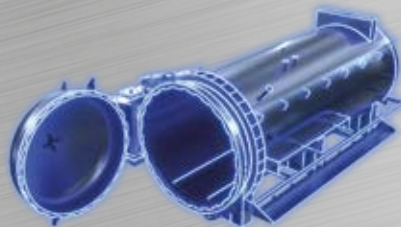
Цифровые  
раскройные плоттеры



Широкий спектр материалов  
Высокая производительность



Системы автоклавного  
формования



Формование изделий из ПКМ  
Вулканизация РТИ  
Полимеризация стеклопакетов

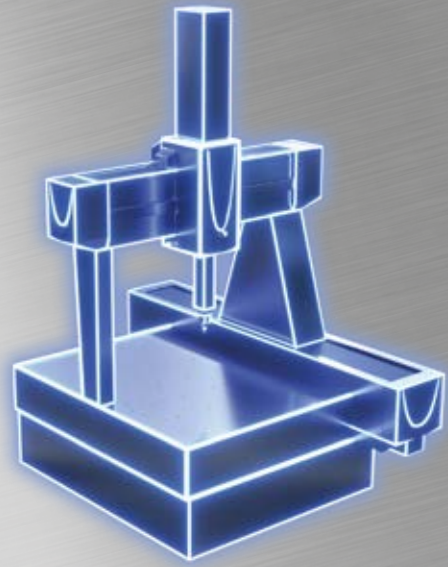


| Объект | Облако точек | Модель |
|--------|--------------|--------|
|        |              |        |

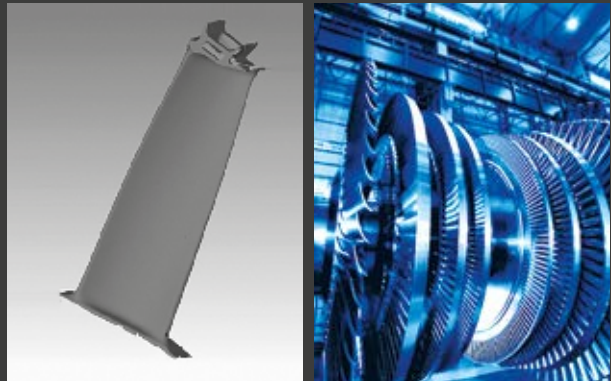


# КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ

## Стационарные КИМ



Диапазон измерений до 8 м  
Погрешность от  $\pm 0.9$  мкм



Деталей машин

Станков и роботов

## Лазерные интерферометры



Диапазон измерений до 45 м  
Погрешность от  $\pm 0.5$  мкм



## Лазерные трекеры



Диапазон измерений до 160 м  
Погрешность от  $\pm 10$  мкм



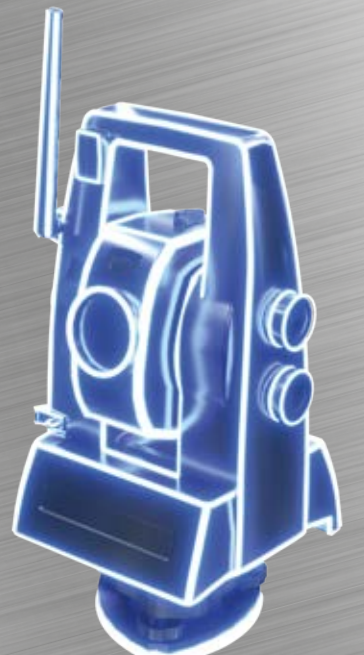
Диапазон измерений до 50 м  
Погрешность от  $\pm 20$  мкм



Крупногабаритных объектов

## Роботизированные тахеометры

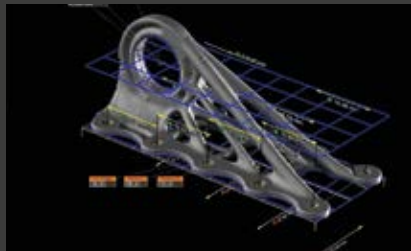
Диапазон измерений до 3500 м  
Погрешность от  $\pm 0.2$  мм



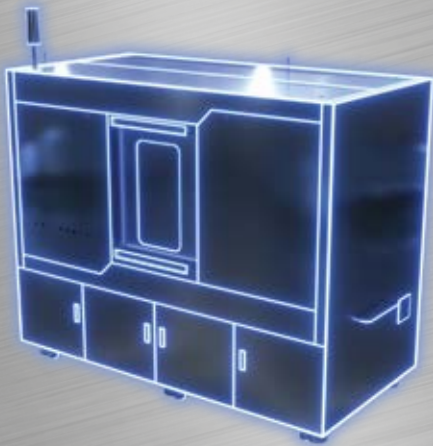
## Лазерные радары



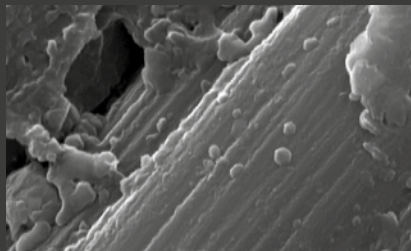
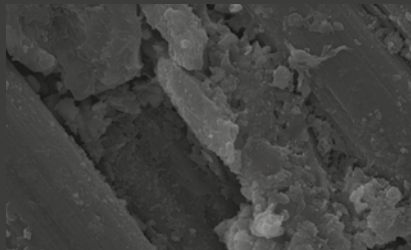
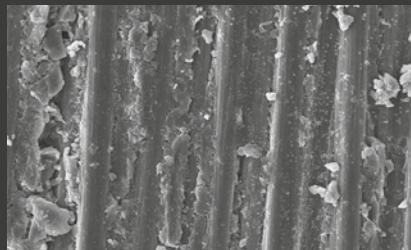




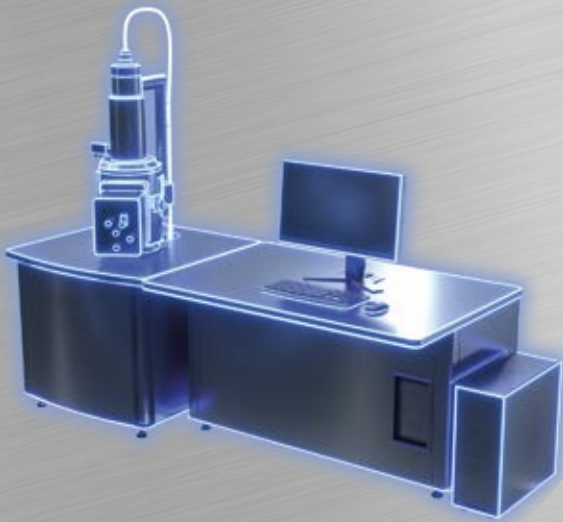
Компьютерные томографы



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Погрешность        | от $\pm 5$ мкм |
| Разрешение         | от 500 нм      |
| Диапазон измерений | до 10 м        |



Электронные микроскопы



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Разрешение                         | от 1,5 нм |
| Возможность оценки химсостава      |           |
| Функция безмасочной нанолитографии |           |

Машины для механических испытаний



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Диапазон нагрузок | от 50 Н до 20 000 кН      |
| Вид нагрузок      | статическая, динамическая |
| Класс точности    | 0,5                       |



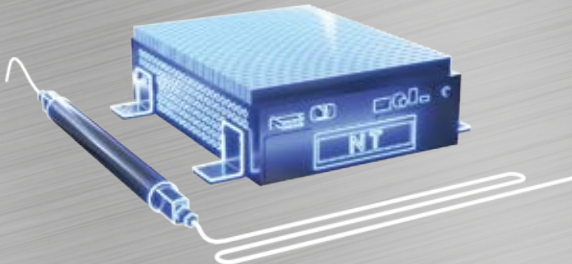
Системы корреляции изображений



|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Рабочая область | от 10 мм <sup>2</sup> до 100 м <sup>2</sup> |
| Погрешность     | 20 мкм/м (0,01 пиксель)                     |



Оптические системы мониторинга



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Параметры          | T, P, a, ε, σ, φ          |
| Погрешность        | от $\pm 0.2$ °C / 2 мкм/м |
| Распред. измерения | до 1500 точек/м длины     |







**Санкт-Петербург**

**Москва**

**Казань**

ул. Новоовсянниковская, д.17, Лит. А | +7 (812) 784-15-34

ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 8А | +7 (495) 305-40-08

ул. Дементьева, д. 16, оф. 201 | +7 (843) 202-07-11

---

[info@nevatec.ru](mailto:info@nevatec.ru) | [www.nevatec.ru](http://www.nevatec.ru)

